

基盤研究支援センター機器分析支援部門上田分室 機器の利用について (COVID-19 対応、2021 年9月 6 日以降)

分室長 高橋伸英

信州大学行動基準の引き上げに伴い、基盤研究支援センター機器分析支援部門上田分室の機器利用について下記のとおりとします。大学の感染症対策行動基準に則った機器利用、実験室利用をお願いいたします。大学 HP「新型コロナウイルスの感染症拡大防止のための信州大学の行動基準」
<https://www.shinshu-u.ac.jp/news/2020/01/post-49.html>

利用について

- 入退棟時には玄関カードリーダーにて記録をお願いします。機器利用簿への記録も徹底してください。
 - マスクの着用と入口での手指消毒、手洗いをお願いします。
 - 利用時間は平日 9 時から20時までとします。
(自動計測する機器は機器のセットや取りはずしの時間を上記の時間内をお願いいたします。
機器予約は機器を専有する時間で通常どおり行ってください)
 - 機器前利用人数は1名のみとします。
 - できるだけ手袋を持参し、機器に直接手を触れないようにしてください。
(アルコール等を用いた機器の消毒は故障の原因となるため行いません。)
 - 測定室のドア開放を含む換気をし、301 実験室は利用時にドラフトをオンにしてください。退出時にはオフにしてください。
 - 試料の確認等で会話が必要なときはグループ間でビデオ通話などを利用し、密接した会話をしないよう心掛けてください。別室などご利用の際はご相談ください。
- ※新 TEM(総研棟1F)については「繊維学部共通利用機器の利用方法について(COVID-19 対応)」をご覧ください。

講習について

- 講習は 1 名ずつとします。グループ講習は不可といたします。
見学したい場合は、Zoom または Google meet 等を使用し別室にて見学してください。
- eALPS に資料がある機器はそちらを予習後、講習を受けてください。
- 分析・測定したいサンプルを事前に知らせてください。

- 基盤研究支援センター機器分析支援部門上田分室 HP アドレス

<https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/kiban/kiki/ueda/>

- 利用頻度の高い機器の資料や動画掲載

基盤研究支援センター機器分析支援部門上田分室 eALPS サイト(どなたでも閲覧可能)

<https://lms.ealps.shinshu-u.ac.jp/common/course/view.php?id=40>